(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2006 年5 月18 日 (18.05.2006)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2006/051896 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/677 (2006.01) *H01L 21/027* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/020704

(22) 国際出願日: 2005 年11 月11 日 (11.11.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2004-330356
2004 年11 月15 日 (15.11.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社ニコン (NIKON CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008331 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 田中 慶一 (TANAKA, Keiichi) [JP/JP]; 〒1008331 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 株式会社ニコン知的財産部内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 古谷 史旺, 外(FURUYA, Fumio et al.); 〒1600023 東京都新宿区西新宿１丁目１９番５号 第２明宝ビル９階 Tokyo (JP).

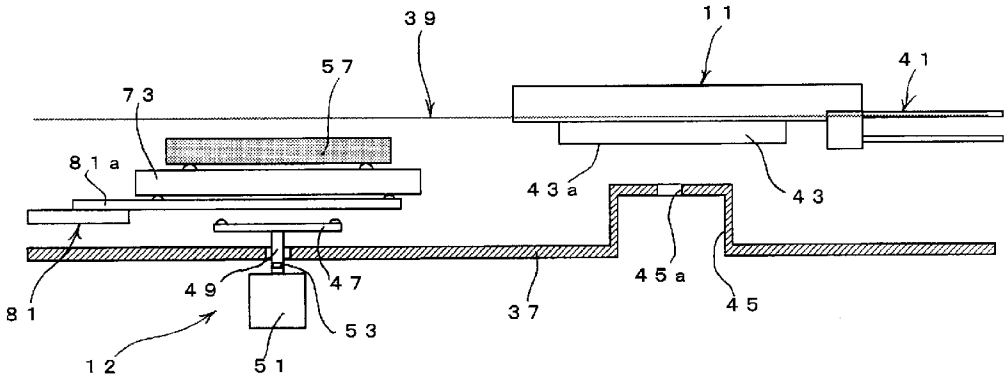
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

[続葉有]

(54) **Title:** SUBSTRATE CARRYING DEVICE, SUBSTRATE CARRYING METHOD, AND EXPOSURE DEVICE

(54) 発明の名称: 基板搬送装置、基板搬送方法および露光装置



(57) **Abstract:** A substrate carrying device and a substrate carrying method for carrying substrates such as reticles and an exposure device. The substrate carrying device capable of securely sucking the substrates onto the lower surface of a chuck comprises a movable stage having the chuck with a substrate sucking face facing downward and movable in the horizontal direction and a fixed blind disposed on the lower side of the movable stage. The movable stage is characterized in that it is horizontally moved to a position out of the fixed blind for attaching and detaching the substrates. Also, the substrate carrying device is characterized by comprising a lifting means having a lifting table movable to a position on the lower side of the movable stage within the movable range of the movable stage and a carrying means having a carrying arm for carrying the substrates to the lifting means.

(57) 要約: 本発明は、レチクル等の基板を搬送する基板搬送装置、基板搬送方法および露光装置に関し、チャックの下面に基板を確実に吸着させることを目的とする。 そして、基板を吸着する吸着面を下向きに有するチャックを備え水平方向に移動可能な可動ステージと、前記可動ステージの下方に配置された固定ブラインドとを備えた基板搬送装置であって、前記可動ステージは、前記固定ブラインドから外れた位置に水平方向に移動して、前記基板を着脱することを特徴とする。また、前記可動ステージの移動範囲内にかつ前記可動ステージより下方となる位置に位置可能な昇降テーブルを備えた昇降手段と、前記基板を前記昇降手段に搬送する搬送アームを備えた搬送手段とを有することを特徴とする。

[続葉有]

WO 2006/051896 A1

SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。